

淡江大學 1 1 1 學年度第 1 學期課程教學計畫表

課程名稱	微機電系統概論	授課 教師	楊龍杰 YANG LUNG-JIEH
	TOPICS ON MICROELECTROMECHANICAL SYSTEMS		
開課系級	共同科－工 A	開課 資料	遠距課程 選修 單學期 2學分
	TGEXB0A		
課程與SDGs 關聯性	SDG4 優質教育 SDG8 尊嚴就業與經濟發展		
系 (所) 教育 目 標			
大學部之教育目標以培育具備工程專業及素養之工程師。			
本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重			
<p>A. 具備基礎資訊技術及電腦軟體能力，以解決工程問題。(比重：50.00)</p> <p>B. 專業倫理認知。(比重：10.00)</p> <p>C. 具備相關工程與應用所需的基本數理與工程知識。(比重：40.00)</p>			
本課程對應校級基本素養之項目與比重			
<p>1. 全球視野。(比重：15.00)</p> <p>2. 資訊運用。(比重：10.00)</p> <p>3. 洞悉未來。(比重：10.00)</p> <p>4. 品德倫理。(比重：5.00)</p> <p>5. 獨立思考。(比重：30.00)</p> <p>6. 樂活健康。(比重：5.00)</p> <p>7. 團隊合作。(比重：15.00)</p> <p>8. 美學涵養。(比重：10.00)</p>			
課程簡介	本課程從費曼著名的演講"窺究到底,空間還多得很"開始,介紹微細加工與X光深刻模造術,並強調目前在民生產業之應用與衝擊,包括噴墨印表,壓力計,投影機,加速度計等.本課程為遠距課程,12週次在家收播Moodle課程,並與教師/助教進行學習互動.		

	This introductory course for undergraduate students begins with Feynman's famous speech: "There's plenty of rooms at the bottom." Semiconductor processing, bulk micromachining, surface micromachining, CMOS, LIGA, polymer MEMS process are then introduced. Interesting applications of MEMS devices e.g. inkjet heads, pressure sensors, DLP, accelerometers show up the current impact of MEMS on our daily life. This course is a distant-education course and students will be asked to see (12 weeks) teaching videos on internet (Moodle platform).
--	--

本課程教學目標與認知、情意、技能目標之對應

將課程教學目標分別對應「認知 (Cognitive)」、「情意 (Affective)」與「技能 (Psychomotor)」的各目標類型。

- 一、認知 (Cognitive)：著重在該科目的事實、概念、程序、後設認知等各類知識之學習。
- 二、情意 (Affective)：著重在該科目的興趣、倫理、態度、信念、價值觀等之學習。
- 三、技能 (Psychomotor)：著重在該科目的肢體動作或技術操作之學習。

序號	教學目標 (中文)	教學目標 (英文)
1	掌握精微前瞻科技的能力	To govern the capability of front-edge technology about MEMS and nanotech.
2	了解理工跨領域合作之重要性	To understand the importance of multi-discipline cooperation in science and technology.

教學目標之目標類型、核心能力、基本素養教學方法與評量方式

序號	目標類型	院、系(所)核心能力	校級基本素養	教學方法	評量方式
1	認知	ABC	12345678	講述	測驗、作業、討論(含課堂、線上)、遠距非同步
2	認知	ABC	12345678	講述	測驗、作業、討論(含課堂、線上)、遠距非同步

授課進度表

週次	日期起訖	內容 (Subject/Topics)	備註 (請註明為同步、非同步課程)
1	111/09/05~ 111/09/11	課程簡介	面授9/8
2	111/09/12~ 111/09/18	(1)微機電介紹	面授9/15
3	111/09/19~ 111/09/25	(2)半導體製程與設備	遠距收播
4	111/09/26~ 111/10/02	(3)矽質微加工(Silicon micromachining-1)	遠距收播
5	111/10/03~ 111/10/09	(3)矽質微加工(Silicon micromachining-2)	遠距收播
6	111/10/10~ 111/10/16	(4)金氧半(CMOS)微機電技術	遠距收播
7	111/10/17~ 111/10/23	(5)高深寬比(LIGA & LIGA-like)微加工技術	遠距收播

8	111/10/24~ 111/10/30	(6)高分子(Polymer)微機電技術-1	遠距收播
9	111/10/31~ 111/11/06	(6)高分子(Polymer)微機電技術-2+期中面授複習	面授11/3
10	111/11/07~ 111/11/13	期中考試週	
11	111/11/14~ 111/11/20	期中考檢討+(7)微感測器(Micro sensors)技術-1	面授11/17
12	111/11/21~ 111/11/27	(7)微感測器(Micro sensors)技術-2	遠距收播
13	111/11/28~ 111/12/04	(8)微致動器(Micro actuators)	遠距收播
14	111/12/05~ 111/12/11	(9)光學微機電(Optical MEMS)	遠距收播
15	111/12/12~ 111/12/18	(10)生醫微機電(Bio MEMS)技術	遠距收播
16	111/12/19~ 111/12/25	(11)微流體(Microfluidics)技術	遠距收播
17	111/12/26~ 112/01/01	(12)微型飛行器+期末面授複習	面授12/29
18	112/01/02~ 112/01/08	期末考試週(本學期期末考試日期為:112/1/3-112/1/9)	
修課應 注意事項	本課程為遠距非同步課程,非面授週次不必到課堂上課,採ICLASS遠距教學影片收播,以及線上互動,遠距收播週次,老師線上出題目,每位同學都必須線上繳交作業,當作平時評量成績,佔總成績30%的比重,請同學務必注意.		
教學設備	電腦、投影機		
教科書與 教材	「掌握微機電」, 楊龍杰著, 滄海書局		
參考文獻	other MEMS journal papers		
批改作業 篇數	篇 (本欄位僅適用於所授課程需批改作業之課程教師填寫)		
學期成績 計算方式	◆出席率: 10.0 % ◆平時評量: 30.0 % ◆期中評量: 30.0 % ◆期末評量: 30.0 % ◆其他〈 〉: %		

備 考	<ol style="list-style-type: none">1. 「教學計畫表管理系統」網址：https://info.ais.tku.edu.tw/csp 或由教務處首頁→教務資訊「教學計畫表管理系統」進入。2. 依「專科以上學校遠距教學實施辦法」第2條規定：「本辦法所稱遠距教學課程，指每一科目授課時數二分之一以上以遠距教學方式進行」。3. 依「淡江大學數位教學施行規則」第3條第2項，本校遠距教學課程須為「於本校遠距教學平台或同步視訊系統進行數位教學之課程。授課時數包含課程講授、師生互動討論、測驗及其他學習活動之時數」。4. 如有課程臨時異動(含遠距教學、以實整虛課程之上課時間及教室異動)，請依規定向教務處提出申請。 <p>※不法影印是違法的行為。請使用正版教科書，勿不法影印他人著作，以免觸法。</p>
-----	---